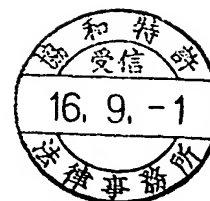


特 許 協 力 条 約

発信人 日本国特許庁 (国際予備審査機関)



出願人代理人

吉武 賢次

様

あて名

〒 100-0005

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号  
富士ビル323号  
協和特許法律事務所

PCT

特許性に関する国際予備報告 (特許協力条約第二章) の  
送付の通知書

(法施行規則第57条)  
[PCT規則71.1]

発送日  
(日.月.年)

31. 8. 2004

出願人又は代理人  
の書類記号

142996-014

重要な通知

国際出願番号

PCT/JPO3/09471

国際出願日

(日.月.年) 25. 07. 03

優先日

(日.月.年) 25. 07. 02

出願人 (氏名又は名称)

東京エレクトロン株式会社

1. 国際予備審査機関は、この国際出願に関して特許性に関する国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、それらをこの送付書とともに送付することを、出願人に通知する。

2. 国際予備報告及び付属書類が作成されている場合には、すべての選択官庁に通知するために、それらの写しを国際事務局に送付する。

3. 選択官庁から要求があったときは、国際事務局は国際予備報告 (付属書類を除く) の英語の翻訳文を作成し、それをその選択官庁に送付する。

4. 注 意

出願人は、各選択官庁に対し優先日から30月以内に (官庁によってはもっと遅く) 所定の手続 (翻訳文の提出及び国内手数料の支払い) をしなければならない (PCT39条(1)) (様式PCT/IB/301とともに国際事務局から送付された注を参照)。

国際出願の翻訳文が選択官庁に提出された場合には、その翻訳文は、国際予備審査報告の付属書類の翻訳文を含まなければならない。この翻訳文を作成し、関係する選択官庁に直接送付するのは出願人の責任である。

選択官庁が適用する期間及び要件の詳細については、PCT出願人の手引き第II巻を参照すること。

出願人はPCT第33条(5)に注意する。すなわち、PCT第33条(2)から(4)までに規定する新規性、進歩性及び産業上利用可能性の基準は国際予備審査にのみ用いるものであり、締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たっては、追加の又は異なる基準を適用することができる (PCT第27条(5)も併せて参照)。そのような追加の基準は、例えば、実施可能要件や特許請求の範囲の明確性及び裏付け要件を、特許要件から免除することを含む。

名称及びあて名

日本国特許庁 (IPEA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

権限のある職員

特 許 庁 長 官

3S

7523

電話番号 03-3581-1101 内線 3390

様式PCT/ IPEA/ 416 (2004年1月)

(添付用紙の注意書きを参照)

## 注 意

### 1. 文献の写しの請求について

国際予備審査報告に記載された文献であって国際調査報告に記載されていない文献の複写

特許庁にこれらの引用文献の写しを請求することもできますが、独立行政法人工業所有権総合情報館（特許庁庁舎2階）で公報類の閲覧・複写および公報以外の文献複写等の取り扱いをしています。

#### 〔担当及び照会先〕

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号（特許庁庁舎2階）

独立行政法人工業所有権総合情報館

【公報類】 閲覧部 TEL 03-3581-1101 内線3811～2

【公報以外】 資料部 TEL 03-3581-1101 内線3831～3

また、（財）日本特許情報機構でも取り扱いをしています。

これらの引用文献の複写を請求する場合は下記の点に注意してください。

#### 〔申込方法〕

（1）特許（実用新案・意匠）公報については、下記の点を明記してください。

○特許・実用新案及び意匠の種類

○出願公告又は出願公開の年次及び番号（又は特許番号、登録番号）

○必要部数

（2）公報以外の文献の場合は、下記の点に注意してください。

○国際予備審査報告の写しを添付してください（返却します）。

#### 〔申込み及び照会先〕

〒135-0016 東京都江東区東陽4-1-7 佐藤ビル

財団法人 日本特許情報機構 情報処理部業務課

TEL 03-3508-2313

注） 特許庁に対して文献の写しの請求をすることができる期間は、国際出願日から7年です。

2. 各選択官庁に対し、国際出願の写し（既に国際事務局から送達されている場合は除く）及びその所定の翻訳文を提出し、国内手数料を支払うことが必要となります。その期限については各国ごとに異なりますので注意してください。（条約第22条、第39条及び第64条(2)(a)(i)参照）

特 許 協 力 条 約

P C T

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第12条、法施行規則第56条）  
〔PCT36条及びPCT規則70〕

出願人又は代理人 の書類記号 142996-014	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JP03/09471	国際出願日 (日.月.年) 25.07.03	優先日 (日.月.年) 25.07.02	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl <sup>7</sup> H01L21/68, B65G49/07, H01L21/027			
出願人 (氏名又は名称) 東京エレクトロン株式会社			

- この報告書は、PCT35条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第57条（PCT36条）の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
- この報告には次の附属物件も添付されている。
  - ☐ 附属書類は全部で \_\_\_\_\_ ページである。
    - ☐ 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙（PCT規則70.16及び実施細則第607号参照）
    - ☐ 第I欄4.及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
  - ☐ 電子媒体は全部で \_\_\_\_\_ (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。（実施細則第802号参照）

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 国際予備審査報告の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 25.11.2004	国際予備審査報告を作成した日 12.08.2004		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員)  柴沼 雅樹	3S	7523
		電話番号 03-3581-1101 内線 3390	

## 第1欄 報告の基礎

1. この国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。

☐ この報告は、\_\_\_\_\_ 語による翻訳文を基礎とした。

それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。

- ☐ PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査  
☐ PCT規則12.4にいう国際公開  
☐ PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの  
 第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付で国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に“superseded”と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-16	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲	11, 15	有
	請求の範囲	1-10, 12-14, 16	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-16	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

- 文献1: JP 2002-164410 A (東京エレクトロン株式会社) 2002.06.07, 段落 [0159] - [0162]  
 文献2: JP 2-238616 A (東京エレクトロン株式会社) 1990.09.20, 第1ページ右下欄第5行-第2ページ右下欄第10行  
 文献3: WO 94/17353 A1 (MOOR EPITAXIAL, INC.) 1994.08.04, 第66ページ第18行-第68ページ第3行,  
 & EP 1154039 A1,  
 & US 5683518 A,  
 & JP 7-505261 A, 第30ページ右下欄第16行-第31ページ左下欄第3行  
 文献4: JP 4-158511 A (東京エレクトロン株式会社) 1992.06.01, 第3ページ右上欄第4行-第4ページ左上欄第20行  
 文献5: JP 10-308348 A (東京エレクトロン株式会社) 1998.11.17, 段落 [0025] - [0029]  
 文献6: US 4465201 A (THE UNITED STATES OF AMERICA) 1984.08.14, 第3欄第48行-第4欄第13行,  
 & JP 59-144823 A, 第3ページ左下欄第4行-同右下欄第20行  
 文献7: JP 2000-18207 A (東京エレクトロン株式会社) 2000.01.18, 要約

(1) 請求の範囲1, 6, 8, 9, 16について

この発明は、先の国際調査報告で引用された文献1及び文献2または3から進歩性を有しない。

文献2または3には、支持基板ロッドの頭部が、第1の高さに位置しているときに容器本体の開口孔上端を塞ぐようにした基板処理装置が記載されているから、当該構成を文献1記載のものに適用してこの発明のようになったことは、当業者の容易に想到しえたことである。

また、安全のために駆動手段、開閉手段にロック機構を設けることは周知慣用手段にすぎないから、「アームロック機構」、「蓋体ロック機構」を設けた点は、当業者の必要に応じて適宜なしえた設計的事項にすぎない。

## 補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

## 第 V 欄の続き

## (2) 請求の範囲 2, 3, 7 について

この発明は、先の国際調査報告で引用された文献 1 及び文献 2 から進歩性を有しない。

文献 2 には、支持ロッドの頭部が収容され、底部に弾性シール部材が配置された窪みが容器本体上面に形成された基板処理容器が記載されている。

## (3) 請求の範囲 4 について

この発明は、先の国際調査報告で引用された文献 1 及び文献 3 から進歩性を有しない。

文献 3 には、基板支持ロッドの頭部に設けられた下方に向けて先細となる外周面、およびこれと相補的な形状を有する孔内周面とで、処理流体の進入を防止するシールを形成した基板処理装置が記載されている。

## (4) 請求の範囲 5 について

この発明は、先の国際調査報告で引用された文献 1 及び文献 2 または 3、および文献 4, 5 から進歩性を有しない。

文献 4, 5 記載のように、第 1 の高さよりも高く基板の下面を支持することができる複数の基板支持部材は周知のものである。

## (5) 請求の範囲 10, 12, 13 について

この発明は、先の国際調査報告で引用された文献 1 及び文献 2 または 3、および新たに引用された文献 6 から進歩性を有しない。

複数のシール部分によって処理空間と反対側に画成された密閉空間を所定の圧力として、圧力計の検出値によりリークの有無を判断することは、引用文献 6 記載のように周知の技術である。また、毒性ガスが排出する危険性がある箇所に、当該独ガスを処理するラインを設けることは、周知慣用手段にすぎない。

## (6) 請求の範囲 11 について

この発明は、国際調査報告で引用された文献 1 - 5, 7 および新たに引用した文献 6 に対して進歩性を有する。

ロッドが貫通する孔によって画成される密閉空間の圧力を検出してリークを確認するようにした点は、何れの文献にも記載されていない。

## (7) 請求の範囲 14 について

この発明は、先の国際調査報告で引用された文献 1 及び文献 2 または 3、および引用文献 7 から進歩性を有しない。

周知のエアシリンダを支持ロッドの駆動装置とした基板処理容器は、文献 7 記載のように周知のものである。

## (8) 請求の範囲 15 について

この発明は、国際調査報告で引用された文献 1 - 5, 7 および新たに引用した文献 6 に対して進歩性を有する。

蓋体を下降させたときに、基板支持ロッドの頭部に接して当該ロッドを押し下げる押圧部材を設けた点は、上記何れの文献にも記載されていない。